

Title (en)  
DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING A MATT SURFACE

Title (de)  
VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM MATTIEREN EINER OBERFLÄCHE

Title (fr)  
DISPOSITIF ET PROCÉDÉ POUR PRODUCTION D'UNE SURFACE MATE

Publication  
**EP 3578297 A1 20191211 (DE)**

Application  
**EP 18175773 A 20180604**

Priority  
EP 18175773 A 20180604

Abstract (en)  
[origin: WO2019233839A1] The invention relates to a device (1, 1A) for matting a surface (12), having a nozzle (3, 3A), which has a blasting chamber (4, 4A) for blasting a workpiece (10, 10A) with an abrasive blasting material, wherein the blasting chamber (4, 4A) has, on at least one of the sides of same, at least one flat interaction opening (5.2), which is provided for being interlockingly placed onto at least one surface (12) to be matted, the blasting chamber (4, 4A) being closed as a result. According to the invention, the workpiece (10, 10A) and the nozzle (3, 3A) remain rigid with respect to one another during the blasting process, wherein a direction of a blasting agent blast (9) of abrasive material within the blasting chamber (4, 4A) can be oriented approximately parallel or at an angle of less than 30° to the interaction opening (5.2) and to the surface (12) to be matted.

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1, 1A) zum Mattieren einer Oberfläche (12), mit einer Düse (3, 3A), welche eine Strahlkammer (4, 4A) zur Bestrahlung eines Werkstücks (10, 10A) mit einem abrasiven Strahlungsmaterial aufweist, wobei die Strahlkammer (4, 4A) an mindestens einer ihrer Seiten mindestens eine flächige Interaktionsöffnung (5.2) aufweist, welche dafür vorgesehen ist, formschlüssig auf mindestens eine zu mattierende Oberfläche (12) aufgesetzt zu werden, so dass die Strahlkammer (4, 4A) dadurch geschlossen wird. Erfindungsgemäß bleiben das Werkstück (10, 10A) und die Düse (3, 3A) während des Bestrahlungsvorgangs starr zueinander, wobei eine Richtung eines Strahlmittelstrahls (9) aus abrasiven Material innerhalb der Strahlkammer (4, 4A) in etwa parallel oder unter einem Winkel kleiner 30° zur Interaktionsöffnung (5.2) und der zu mattierenden Oberfläche (12) ausrichtbar ist.

IPC 8 full level  
**B24C 1/06** (2006.01); **B24C 3/04** (2006.01); **B24C 5/04** (2006.01); **B24C 9/00** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**B24C 1/06** (2013.01); **B24C 3/04** (2013.01); **B24C 5/04** (2013.01); **B24C 9/003** (2013.01)

Citation (applicant)  
DE 102015013167 A1 20170413 - AUDI AG [DE]

Citation (search report)  
• [XYI] EP 0350965 A2 19900117 - MICK ALEXANDRA  
• [YA] GB 681524 A 19521022 - WINGFOOT CORP  
• [A] JP 2017039195 A 20170223 - FUJI SEISAKUSHO:KK  
• [A] WO 9807549 A1 19980226 - REH RICARDO [CH], et al  
• [AD] DE 102015013167 A1 20170413 - AUDI AG [DE]  
• [A] DE 102010009933 B3 20110512 - WIWOX GMBH SURFACE SYSTEMS [DE]

Cited by  
DE102020124668B3; DE102020122129B3

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3578297 A1 20191211**; **EP 3578297 B1 20211222**; CN 112105483 A 20201218; CN 112105483 B 20220527; WO 2019233839 A1 20191212

DOCDB simple family (application)  
**EP 18175773 A 20180604**; CN 201980031167 A 20190529; EP 2019063913 W 20190529